In_xGa_{1-x}N/GaN 多重量子井戸構造における ストークスシフトの温度依存性

佐々木千治 (物質工学専攻) 岩田政樹 (電気電子工学専攻) 山田陽一 (電気電子工学科) 田口常正 (電気電子工学科) 渡辺智 (アジレント研究所) M. S. Minsky (アジレント研究所) 竹内哲也 (アジレント研究所) 山田範秀 (アジレント研究所)

Temperature dependence of Stokes shift in $In_xGa_{1-x}N/GaN$ multiple quantum wells

Chiharu SASAKI (Department of Materials Science and Engineering) Masaki IWATA (Department of Electrical and Electronic Engineering) Yoichi YAMADA (Department of Electrical and Electronic Engineering) Tsunemasa TAGUCHI (Department of Electrical and Electronic Engineering) Satoshi Watanabe (Agilent Laboratories) Milan S. Minsky (Agilent Laboratories) Tetsuya TAKEUCHI (Agilent Laboratories) Norihide YAMADA (Agilent Laboratories)

Luminescence properties of $In_xGa_{1-x}N/GaN$ multiple quantum wells (MQWs) have been studied by means of photoluminescence excitation (PLE) spectroscopy. The clear peak due to the absorption of $In_xGa_{1-x}N$ quantum wells was observed in the PLE spectrum of the MQW sample with x < 0.01 at 4 K, and the Stokes shift was estimated to be 63 meV. It was found that the Stokes shift was independent of temperature up to 300 K. This result suggests that the large Stokes shift cannot be explained only by the effect of carrier localization due to compositional fluctuation.

Key Words : $In_xGa_{1-x}N/GaN$ multiple quantum wells , photoluminescence excitation, Stokes shift, compositional fluctuation, localization,

1. はじめに

現在、GaN 系半導体に関しては、短波長発光デバ イス材料として多くの研究が行われており、すでに $In_xGa_{1-x}N$ 混晶を活性層に用いた青色・緑色発光ダイ オード(LED: light emitting diode)および紫色半導体 レーザ(LD: Laser diode)は製品化されている^{1,2)}。ま た、白色 LED も製品化されており、照明への応用 の研究もはじまっている。

しかしながら、 $In_xGa_{1-x}N$ 混晶についてはその発光 機構については不明な点が多く、様々な議論がされ ている ³⁻⁶⁾。 $In_xGa_{1-x}N$ 混晶発光デバイスは、その結 晶中に欠陥密度が 10⁸~10¹⁰ cm⁻² あるにもかかわら ず、発光効率が高く、素子寿命も長い。この発光特 性を理解することで、デバイスの高品質化や新しい デバイスの開発につながると期待されている。

本研究では、量子井戸活性層の In 組成 x の異な る一連の In_xGa_{1-x}N/GaN 多重量子井戸構造を用いて、 励起スペクトルの測定を行った。その結果として、 x < 0.01 である In_xGa_{1-x}N/GaN 多重量子井戸構造の 4 K の励起スペクトルにおいて、In_xGa_{1-x}N 量子井戸 活性層からの明瞭な吸収ピークが観測された。吸収 と発光のエネルギー差で定義されるストークスシ フト(Stokes shift)は、63 meV と見積もられた。この 明瞭な吸収ピークが観測された x < 0.01 である 山口大学工学部研究報告



from In_xGa_{1-x}N/GaN MQW samples with (A) x < 0.01, (B) x = 0.06, (C) x = 0.18, and (D) x = 0.22.

In_xGa_{1-x}N/GaN 多重量子井戸構造について、励起ス ペクトルの温度依存性の測定を行い、ストークスシ フトの温度依存性について考察を行った。

2. 実験

測定には MOVPE(metalorganic vapor phase epitaxy)法によりサファイア基板上に作製された In_xGa_{1-x}N/GaN 多重量子井戸構造を用いた。量子井 戸活性層のIn組成xは、(A)x<0.01, (B)x=0.06, (C) x=0.18, (D) x=0.22 である。

発光スペクトル(PL: photoluminescence)および励 起スペクトル(PLE: photoluminescence excitation)の 測定には、Xe-Clエキシマレーザ(発振波長 308 nm, パルス幅 20 ns, 繰り返し周波数 100 Hz)励起の 色素レーザを用いた。発光スペクトルは、分光器を 用いて測定を行った。

時間分解発光分光の測定には、モードロック Ti: Al₂O₃ レーザおよびその再生増幅されたフェムト秒 光パルスの第3高調波(発振波長 266 nm, パルス 幅 200 fs, 繰り返し周波数 250 kHz) を用い、発光 ダイナミクスはストリークカメラで測定を行った。

結果と考察

図1に4Kにおける量子井戸活性層のIn組成 x の異なる一連の In_xGa_{1-x}N/GaN 多重量子井戸構造の Vol.52 No.1 (2001)



発光スペクトルとその発光ピーク位置を検出位置 とした励起スペクトルを示す。まず、量子井戸活性 層の In 組成 x の増加に伴い、発光スペクトルは低 エネルギー側にシフトしていることが分かる。それ ぞれの試料の発光ピークエネルギー位置は、3.312 eV(x < 0.01), 3.043 eV(x = 0.06), 2.784 eV(x = 0.18), 2.672 eV(x = 0.22)である。また、約 3.480 eV に観測 される発光は GaN クラッド層からの発光である。

図から明らかなように、In 組成 x が x < 0.01 であ る In_xGa_{1-x}N/GaN 多重量子井戸構造励起スペクトル において、量子井戸活性層からの吸収ピークが明瞭 に観測されている。その吸収ピーク位置は 3.375 eV であり、吸収と発光のエネルギー差で定義されるス トークスシフトは 63 meV となった。この値はこれ までに報告されている In_xGa_{1-x}N 混晶のストークス シフトの値に近い。しかし、これまでに報告されて いる In_xGa_{1-x}N 混晶の励起スペクトルは、低エネル ギー側に裾を引いたブロードなスペクトルである のに対し、今回測定された励起スペクトルでは In_xGa_{1-x}N 量子井戸活性層の吸収ピークが明瞭に観 測されている。従って、In_xGa_{1-x}N 混晶の吸収端を正 確に見積もることができる。In_xGa_{1-x}N 多重量子井戸 構造において、このような明瞭な吸収ピークが観測 された報告はなく、In_xGa_{1-x}N 混晶の発光特性を議論 する上で、非常に重要な結果である。

この吸収構造は In 組成 x の増加に伴って、ブロ ードとなり明瞭なピークは観測されなくなる。その ため、図1において矢印(↓)で示した点を吸収位置 と仮定して各試料におけるストークスシフトの値



taken from an $In_xGa_{1-x}N/GaN$ MQW sample with x < 0.01.

を見積もった。図2に、4Kにおけるストークスシフトの In 組成依存性を示す。図から明らかなように、In 組成 x の増加に伴い、ストークスシフトの値が大きくなっていることが分かる。このことは、In 組成 x の増加によって、In 組成揺らぎが大きくなったためと考えられる。また、In 組成の小さい領域(0~10%)では、ストークスシフトは急激な増大を示した。このことは、In による混晶の効果が発光特性に大きな影響を与えていることを示していると考えられる。

次に、明瞭な吸収構造が観測された x < 0.01 であ る In_xGa_{1-x}N/GaN 多重量子井戸構造について詳しく 考察を行った。図 3 に 4 K における発光スペクトル と励起スペクトルの励起パワー密度依存性を示す。 励起パワー密度は、4.8~95 kW/cm² まで変化させた。 図から明らかなように、励起パワー密度を増加させ ても、発光スペクトルおよび励起スペクトルのピー ク位置はほとんど変化していないことが分かる。こ のことは、この試料においてはピエゾ電界の影響が ほとんどないことを示している。これは、GaN 障壁 層にドナー不純物である Si が添加ため、ピエゾ電 界がスクリーニングされているためであると考え られる。

x < 0.01 である In_xGa_{1-x}N/GaN 多重量子井戸構造 のストークスシフトの温度依存性について調べる ために、発光スペクトルおよび励起スペクトルの温 度依存性の測定を行った。図4に発光スペクトルお



Figure 4. Temperature dependence of PL and PLE spectra taken from an $In_xGa_{1-x}N/GaN$ MQW sample with x < 0.01 at 4, 90, 180, and 300 K



Figure 5. PL and PLE peak photon energies, and Stokes shift of an $In_xGa_{1-x}N/GaN$ MQW sample with x < 0.01 as a function of temperature.

よび励起スペクトルの温度依存性を示す。低温領域 では、量子井戸活性層からの明瞭なピークが観測さ れていることが分かる。温度上昇に伴って、発光ス ペクトルおよび励起スペクトルのピーク位置は、ブ ロードになり、低エネルギー側へシフトした。さら に、300 K においても、吸収ピークが観測され、ス トークスシフトは約 62 meV と見積もられた。この ことは、300 K においてもキャリアは強く局在して



Figure 6. Time-resolved luminescence in an $In_xGa_{1-x}N/GaN$ MQW sample with x < 0.01 at 7 and 300 K.

いることを示していると考えられる。

図 6 に発光スペクトルおよび励起スペクトルの ピーク位置とストークスシフトの温度依存性を示 す。図中には、励起スペクトルにおいて観測された GaN の吸収ピークも示してある。まず、In_xGa_{1-x}N の吸収ピークと GaN の吸収ピークを比較すると、 温度に対する変化は In_xGa_{1-x}N の方が大きいことが 分かる。GaN の吸収ピークの温度依存性は、GaN のバンドギャップの温度による変化と一致するこ とが分かった。発光スペクトルの In_xGa_{1-x}N のピー ク位置は、励起スペクトルにおいて観測された吸収 ピーク位置と同様の温度依存性を示した。その結果 として、吸収と発光のエネルギー差で定義されるス トークスシフトは、温度に依存せずほぼ一定であっ た。

この大きなストークスシフトの起源が、In 組成不 均一広がりに局在したキャリアまたは励起子であ るとすると、温度上昇に伴ってこのストークスシフ トの値は小さくなるはずである。しかしながら、本 研究によって得られた結果は、ストークスシフトは 温度依存性がないというものであり、このことは、 前述した理論では In_xGa_{1-x}N/GaN 多重量子井戸構造 の発光機構を説明できないことを示している。その ため、その他の局在過程があるものと考えられる。

キャリアの局在化について調べるために、時間分 解発光分光の温度依存性の測定を行った。この結果 から、発光寿命の発光エネルギー依存性を調べるこ とによって、キャリアの局在化について議論するこ とができる⁷⁾。図 6 に x < 0.01 である $In_xGa_{1-x}N/GaN$ Vol.52 No.1 (2001)



Figure 7. Temperature dependence of PL lifetime in an $In_xGa_{1-x}N/GaN$ MQW sample with x < 0.01.





多重量子井戸構造の7Kおよび300Kにおける発光 ピーク位置における発光減衰特性を示す。図から明 らかなように、7Kおよび300Kの発光減衰特性は どちらも単一指数関数的減衰ではないため、2つの 発光減衰成分があると仮定して、(1)式を用いてフィ ッテングを行った。

$$I(T) = A \exp\left(-\frac{t}{\tau_1(T)}\right) + B \exp\left(-\frac{t}{\tau_2(T)}\right)$$
(1)
$$\tau_1, \tau_2 : 発光寿命, \ A, B : 定数$$

7 K において、発光寿命は速い成分と遅い成分がそ れぞれ、0.61, 4.0 ns であった。一方 300 K において は、それぞれの成分は 0.08, 0.2 ns となり、7 K と比 較して発光寿命は非常に短くなることが分かった。 図 7 に x < 0.01 である $In_xGa_{1,x}N/GaN$ 多重量子井戸 構造の発光ピーク位置における発光寿命の温度依 存性を示す。低温領域では、発光寿命はほとんど変 化せず、一定であったのに対し、120 K 以降の温度 領域ではでは急激に発光寿命が減少している。この ような傾向は、発光強度の温度依存性にも現れてい る。これらのことは、励起されたキャリアが非輻射 再結合中心に捕獲される割合が増え、非輻射再結合 が支配的となっていることを示している。

図8に7Kおよび300Kにおける発光寿命の発光 エネルギー依存性を示す。7Kにおいては、高エネ ルギー側では発光寿命が速く、低エネルギー側に行 くに従い、発光寿命が長くなり飽和するという結果 が得られた。このことは、7Kにおいてキャリアが 局在しており、高エネルギー側から低エネルギー側 への遷移が起こっていることを示しており、キャリ アの局在化を表しているものと考えられる。一方、 300Kにおいて発光寿命は発光エネルギーに依存せ ず、ほぼ一定になった。このことは、300Kにおい ては、キャリアは熱エネルギーによって、非局在化 していることを示している。しかし、300Kにおけ るストークスシフトは62 meVとなっており、この 大きなストークスシフトはキャリアの局在化では 説明できないことが分かった。

GaN 系半導体は、電子-フォノン相互作用が強い ことが知られている⁸⁾。GaN および InN の LO フォ ノンの結合エネルギーは、それぞれ、92 meV、86 meV であり、III-V族化合物半導体である GaAs の 35 meV と比べても非常に大きな結合エネルギーを 有している。また、フォノンとの相互作用の大きさ を示すフレーリッヒ結合定数も大きい。そのため、 励起された電子は、フォノンの影響を強く受ける。 その結果として、発光特性にフォノンが大きく関わ っていると考えられる。このことは、ストークスシ フトに温度依存性がないことからも示唆される。

4. おわりに

量子井戸活性層の In 組成 x の異なる一連の In_xGa_{1-x}N/GaN 多重量子井戸構造について、励起ス ペクトルの測定を行った。4 K における励起スペク トルの測定結果から、In 組成 x の増加に伴い、スト ークスシフトが増大することが分かった。これは、 In 組成揺らぎが大きくなったことに起因している ことが分かった。x < 0.01 である In_xGa_{1-x}N/GaN 多重 量子井戸構造の励起スペクトルにおいて、量子井戸 活性層からの明瞭な吸収ピークが観測された。この 試料において、励起スペクトルの温度依存性を行っ たところ、ストークスシフトは温度に対して変化せ ず一定であるということが分かった。このストーク スシフトの温度依存性の結果は、In 組成不均一広が りに局在したキャリアでは説明できず、電子-フォ ノンの相互作用が関与していることが示唆された。

謝辞

本研究は、METI/NEDO/JRCM 高効率電光変換化 合物半導体開発(通称"21 世紀のあかり")プロジェク トの援助を受けて行われたものである。

参考文献

1) S. Nakamura, M. Senoh, N. Iwasa, S. Nagahama, T. Yamada, and T. Mukai, Jpn. J. Appl. Phys. 34, L1332 (1995).

S. Nakamura, M. Senoh, S. Nagahama, T. Matsushita, H. Kiyoku, Y. Sugimoto, T. Kozaki, H. Umemoto, M. Sano, and T. Mukai, Jpn. J. Appl. Phys. 38, L226 (1999).

3) H. Kudo, H. Ishibashi, R. Zheng, Y. Yamada, and T. Taguchi, Phys. Status Solidi. (b) 216, 163 (1999).

4) Y. Narukawa, Y. Kawakami, Sg. Fujita, and S. Nakamura, Phys. Rev. B 59, 10283 (1999).

5) Y. H. Cho, G. H. Gainer, A. J. Fischer, J. J. Song, S. Keller, U. K. Mishra, and S. P. DenBaars, Appl. Phys. Lett. 73, 1370 (1998).

6) R. W. Martin, P. G. Middleton, K. P. O'Donnell, and W. Van der Stricht, Appl. Phys. Lett. 74, 263 (1999).

7) S. Watanabe, M. S. Minsky, N. Yamada, T. Takeuchi, R. Schneider, C. Sasaki, M. Iwata, Y. Yamada, and T. Taguchi, Proc. Int. Workshop on Nitride Semiconductors, Nagoya (Japan), IPAP Conf. Series 1, 532 (2000).

8) R. Zheng, T. Taguchi, and M. Matsuura, J. Appl. Phys. 87, 2526 (2000).

(平成 13 年 8 月 31 日受理)

山口大学工学部研究報告